# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-159501

(43) Date of publication of application: 25.06.1993

(51)Int.CI.

G11B 21/21 B21D 5/01 B23K 26/00 B23K 26/06 E16E 1/02

(21)Application number: 03-322866

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI COMPUTER PERIPHERALS CO LTD

(22)Date of filing:

06.12.1991

(72)Inventor: SHIRAKI KIYONORI

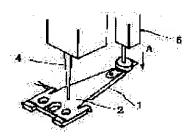
HORIGUCHI YASUSHI UMAGOE YUKIMORI

## (54) MAGNETIC HEAD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a highly reliable magnetic disc unit wherein spring force can be regulated readily at high accuracy.

CONSTITUTION: Under a state where a load spring 1 constituting a head is pushed down, a spring 2 is irradiated with a laser beam 4 to partially remove stress therefrom thus regulating the spring force. Alternatively, the spring part 2 is split to provide a slack part and irradiated wish a laser beam from lateral direction thus regulating the spring force.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

This Page Blank (uspto)

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-159501

(43) 公開日 平成5年(1993) 6月25日

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> G 1 1 B B 2 1 D B 2 3 K	識別記号 21/21 A 5/01 Q 26/00 E	庁内整理番号 9197 — 5 D 9043 — 4 E 7920 — 4 E	FI	技術表示箇所
BZJK		7920 - 4 E		3.496.4
F16F	1/02 B 審査請求 未請求	8917-3 J 請求項の数1		(全3頁)
(21) 出願番号	特願平3-322866		(71) 出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22) 出願日	平成3年(1991)12月	平成3年(1991)12月6日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		, .	(71) 出願人	000233033 日立コンピュータ機器株式会社 神奈川県小田原市国府津2880番地
			(72) 発明者	白木 清典 神奈川県小田原市国府津2880番地株式会社 日立製作所小田原工場内
			(72) 発明者	堀口 泰▲視▼ 神奈川県小田原市国府津2880番地日立コン ピュータ機器株式会社内
			(74)代理人	弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

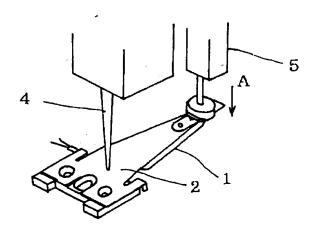
# (54) 【発明の名称】磁気ヘッド

# (57)【要約】

【目的】ばね力の調整を精度よく、容易に行い、信頼性 を向上した、磁気ディスク装置をつくる。

【構成】ヘッドを構成するロードスプリング1を押し下げた状態で、ばね力2にレーザ4を照射することによって、部分的に応力を取り除き、ばね力を調整する。あるいは、ばね部2を分割し、たるみ部を設けて横方向からレーザを照射し、ばね力を調整する。

# 図 2



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 サブミクロンの浮上量をキープしてリー ド、ライトする磁気ディスク用の磁気ヘッドにおいて、 該磁気ヘッドのばね力成形部に切り欠きを設け、ばね厚 み方向に部分的にたるみをもたせた構造として、レーザ を横方向から照射して、ばね力の微調整を行い易くした ことを特徴とする磁気ヘッド。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気ヘッドのばね力調 整方法及び磁気ヘッド構造に係り、特にレーザを用いて 容易に且つ精密にばね力を調整して、信頼性向上を図っ た磁気ヘッドを具備した磁気ディスク装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来磁気ヘッドスプリングのばね力は、 プレス又は、ロール曲げの方法により、あらかじめ所定 の角度にばね部を成形した後、後工程でばね力をロード セルなどの歪計によって測定している。その測定値が規 定値より外れた場合、メカ的に曲げ戻し、あるいは追加 曲げを行って規定値内に調整する方法が一般的に知られ ている。

【0003】また、特開平1-227279に見るよう に、ばね部成形方法としてばね力成形部に収束したレー ザ光パルスを、互いに近接した複数個の走査数で照射す る方法が公知され、曲げ角度ひいてはばね力を所要の値 に正確に合致させれば、微調整工程が不要になるとされ ている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術における メカ的ばね力調整方法では、熟練者によるばね力調整が 必要であり、ばね部にスプリングバックが生じ、ばね力 を髙精度に調整することが困難である。

【0005】一方、ばね成形手段としてレーザ光を複数 個の走査線で照射した場合は、組立工程中でのハンドリ ング等により、ばね力が変化することを考慮すれば、最 終工程でのばね力微調整をしなければならない問題があ る。

【0006】さらに、ばね力を調整する作業において従 来磁気ヘッド構造では、上下方向の空間が是非必要であ 9、HDA (HEAD-DISK-ASSEMBLY) 後、空間を確保できなくなり、ばね力調整が困難である などの問題がある。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上記メカ的ばね力微調整 方法における問題点は、レーザバルスを1点又は、複数 点予め評価した条件 (ロードオン高さ、レーザパワー) でロードスプリングのばね部に照射することによって、 瞬間的に加熱、冷却して解決される。

【0008】一方、HDA後等における横からのばねカ 調整方法においては、ばね部を分解し、ばねの一部をた 50 【0015】また図8に示すようにHDA後、リードラ

るませた構造にすることによって横からのレーザ照射が 可能となり、解決される。

# [0009]

【作用】ばね力を調整するため、ばね部に塑性変形を与 えるメカ的調整方法では、スプリングバック等により、 一般的に金属に於いては経時的にばね力が変化し易い特 性をもつ。

【0010】そこで本発明では、ばね部をロードオンし た状態に押し下げ、ばね応力を発生させ、予め条件出し 10 した位置にレーザを照射することにより、瞬間的に加 熱、冷却でき、ばね応力を部分的に開放できる。これに よりスプリングバックのない、ばね力微調整ができる。 【001'1】また、ばね部にたるみを設けた構造のヘッ ドでは、たるみ部にレーザを予め条件出しした位置、方 法によって照射し、瞬間的に加熱、冷却あるいは溶解す ることによって、ばね応力を部分的に開放できる。これ により、スプリングバックのないヘッドばねの横からの ばね力調整が可能となる。

# [0012]

【実施例】図1は、従来ヘッド構造を示す図で、マウン ト3に取り付けられたロードスプリング1の一部にヘッ ドばね力を与えるばね部2が構成されている。

【0013】図2は、本発明によるばね力微調整方法を 示す図であり、図1のマウント3を固定した状態で、A 方向に力を加え、ロードスプリング 1 を押し下げ、ばね 部2にばね応力を発生させた状態である。図3に示すロ ードスプリング1を押し下げる高さHは、調整量との関 係で決定されるもので、予め評価しておく。そして、ば ね部2にレーザ4を径約φ0.5㎜で照射して、ばね応 30 力を部分的に開放して、ばね力を調整する。調整量は、 レーザの強さ、照射位置、照射数によって変えることが 可能であり、ロードセル 5 で測定しながら行うこともで きる。図4は、本発明請求項2を示すヘッド構造であ る。ヘッドばね部2に細かい溝61を設け、ばね部を分 割した構造になっている。またこの分割したばね6は、 図5に示すように複数個設けてもよい。またロードスプ リングを押し下げた状態で、分割したばね6が、両サイ ドのばね2よりも上側か、下側にふくらむ構造である必 要がある。図 6 (1) ~(3) にその実施例を示すように、ロ 40 ードスプリング1を規定高さまで押し下げた状態の時、 ばね6がたるむ構造、あるいは中央に曲げ部を設け、積 極的に出張る構造にする必要がある。

【0014】図7は、ガラスディスク7の回転により浮 上する磁気ヘッドの浮上量を測定しながら、ばね部6に レーザ4を横方向から照射して、ばね力ひいては浮上量 を調整することを示す図である。ばね力を調整する量に よって、レーザ4の照射条件は異なるが瞬間的に加熱、・・ 冷却または、ばね部の一部を溶かすことで、安定したば ね力の調整ができる。

イトしながらばね力の調整を行うこともでき、ひいては 電磁気特性の調整もできる。

【0016】さらに、HDA状態でなくとも、ヘッド単 体で行うこともでき、浮上量調整、電磁気特性の調整が 可能である。この時は、レーザを横方向からでなくと も、上又は下方向から照射してもよい。

### [0017]

【発明の効果】上述の如く本発明により、スプリングバ ックのないヘッドばね力の微調整方法を提供でき、最終 工程における安定した磁気ヘッド特性を得ることが可能 10 3…マウント となり、HDAの信頼性を向上できる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】従来ヘッドの構造図である。

【図2】本発明の請求項1を説明するヘッドの側面図で

【図3】同じくヘッドの側面図である。

【図4】本発明の請求項2を説明するヘッドの構造図で

【図5】本発明の他の実施例を示す図である。

【図6】同じく他の実施例を示す図である。

【図7】本発明を説明する応用例を示す図である。

【図8】同じく応用例を示す図である。

# 【符号の説明】

1…ロードスプリング

2…ばね力成形部

4…レーザ

5…ロードセル

6…ばね力調整部

7…ガラスディスク

8…磁気ディスク

9…ヘッドアーム

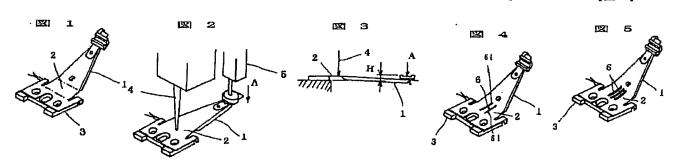
図1]

【図2】

【図3】

【図4】

[図5]



[図6]

【図7】

[図8]

EXI 8

フロントページの続き

(72)発明者 馬越 幸守

神奈川県小田原市国府津2880番地株式会社 日立製作所小田原工場内

This Page Blank (uspto)